PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-103232

(43) Date of publication of application: 02.04.2004

(51)Int.CI.

G11B 7/26

(21)Application number: 2003-321566

(71)Applicant: KOMAG INC

(22)Date of filing:

(72)Inventor: HAPPER BRUCE M

(30)Priority

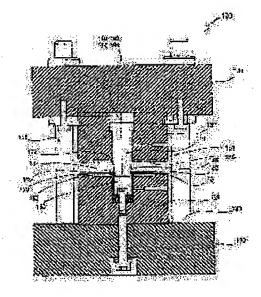
Priority number: 2002 243380 Priority date: 12.09.2002

Priority country: US

(54) DISK POSITIONING SYSTEM FOR MANUFACTURING PATTERNED MEDIA

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device and a method for positioning a disk on an imprinting plane. SOLUTION: In one embodiment, the device has a die including an air bearing mandrel having a tapered nose engaging with an inner diameter of a disk, a circular imprinting plane having a center line being concentric with the air bearing mandrel, and an air bearing gap positioning the disk. An inner diameter of the disk is guided by shifting the upper part of the die toward the lower part of the die in the direction of axis and the center line of the lower part is matched with that of the upper part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許厅(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出顧公開番号

特醒2004-103232 (P2004-103232A)

(43) 公開日 平成16年4月2日 (2004. 4. 2)

(51) Int.C1.7	
G11B	5/84
G11R	7/26

F 1 テーマコード(参考) G11B 5/84 G11B 7/26 521

5D112 5D121

審査請求 未請求 請求項の数 54 〇L (全 17 頁)

GB01 GB04

5D121 AA02 DD06 DD07 DD08 DD13

(21) 出願番号	特願2003-321566 (P2003-321566)	(71) 出顧人	500430198
(22) 出願日	平成15年9月12日 (2003. 9.12)		コマーグ・インコーポレーテッド
(31) 優先権主張番号	10/243, 380		アメリカ合衆国・95131・カリフォル
(32) 優先日	平成14年9月12日 (2002. 9.12)		ニア州・サン ホゼ・オートメーション
(33) 優先権主張国	米国 (US)		パークウエイ・1710
		(74) 代理人	100064621
			弁理士 山川 政樹
		(72) 発明者	ブルース・エム・ハーパー
•			アメリカ合衆国・95139・カリフォル
			ニア州・サン ホゼ・スティルウォーター
		1	レーン・207
		Fターム(参	考) 5D112 AA02 AA20 AA24 BA03 BA04
			BA05 BA10 GA02 GA03 GA09

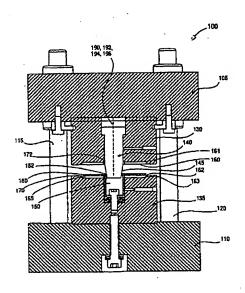
(54) 【発明の名称】 パターン化されたメディア製造のためのディスク位置合わせシステム

(57)【要約】

【課題】ディスクをインプリンティング面に位置合わせ する装置および方法を提供すること。

【解決手段】一実施形態においては、ディスクの内径に 係合するテーパ付ノーズを有する空気軸受けマンドレル を含む金型と、空気軸受けマンドレルと同心の中心線を 有する円形のインプリンティング面と、ディスクを位置 決めする空気軸受け空隙とを有する。上金型が下金型に 向かって軸方向移動することによって、ディスクの内径 が案内されて、上金型の中心線と同時位置合わせされる

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

ディスクの内径に係合するテーパ付ノーズを有する空気軸受けマンドレル、および前記 空気軸受けマンドレルと同心の第1の中心線を有する第1のインプリンティング面を備え る上金型と、

ディスクを支持し、かつ拘束する空気軸受け空隙を有する下金型とを備え、上金型が下金型に向かって軸方向移動することによって、ディスクの内径が案内されて、上金型の第1の中心線と位置合わせされるディスクにインプリンティングする装置。

【請求項2】

インプリンティング面に隣接して配設された、複数の流体空隙をさらに備える請求項1 10 に記載の装置。

【請求項3】

インプリンティング面に結合された複数のピコアクチュエータをさらに備える請求項1 に記載の装置。

【請求項4】

下金型が、空気軸受けマンドレルと同時位置合わせされた第2の中心線を有する、第2 のインプリンティング面をさらに備える請求項1に記載の装置。

【請求項5】

円形のインプリンティング面が、インプリンティング面の表面ばらつきを収容する可撓 性材料を含む請求項1に記載の装置。

【請求項6】

第1のインプリンティング面に結合された可撓性エラストマー・パッドをさらに備える 請求項1に記載の装置。

【請求項7】

複数の流体空隙と流体連通して、ディスクにインプリンティングをするための加熱要素 および冷却要素を供給するデバイスをさらに備える請求項2に記載の装置。

【請永頃8】

デバイスが、熱力学的プレスを含む請求項7に記載の装置。

【請求項9】

テーパ付ノーズを備える第1の空気軸受けマンドレルを有する上金型と、

第1の空気軸受けマンドレルに対向する、テーパ付ノーズを備える第2の空気軸受けマンドレルを有する下金型と、

第1の空気軸受けマンドレルの周りに配置された第1のインプリンティング面と を備え、第1の空気軸受けマンドレル、第2の空気軸受けマンドレル、および第1のイン プリンティング面が、共通の中心線を共有し、かつ第1および第2の空気軸受けマンドレ ルのテーパ付ノーズが噛合ってディスクの内径に係合する、ディスクにインプリンティン グをする装置。

【請求項10】

インプリンティング面が、ディスクの表面のばらつきを吸収するための可撓性材料を含む請求項9に記載の装置。

【請求項11】

インプリンティング面に隣接して配置された複数の流体空隙をさらに備える請求項9に 記載の装置。

【請求項12】

インプリンティング面に結合された複数のピコアクチュエータをさらに備える請求項9に記載の装置。

【請求項13】

第2の空気軸受けマンドレルの周りに配置された第2のインプリンティング面をさらに 備える請求項9に記載の装置。

【請求項14】

50

20

下金型が、下金型を支持して、上金型との位置合わせを可能にする平坦面型空気軸受け 面を備える請求項9に記載の装置。

【請求項15】

下金型が、平坦面と球面の2重空気軸受けネストをさらに備え、下金型をディスクの中心と位置合わせし、かつディスクの中心の周りに回転させることを可能にする請求項9に記載の装置。

【請求項16】

第1のインプリンティング面に結合された可撓性エラストマー・パッドをさらに備える 請求項9に記載の装置。

【請求項17】

複数の流体空隙と流体連通し、ディスクにインプリンティングをするための加熱要素および冷却要素を供給するデバイスをさらに備える請求項11に記載の装置。

【請求項18】

デバイスが熱力学的プレスを備える請求項17に記載の装置。

【請求項19】

インプリンティング面をディスクと受動的に位置合わせするステップと、

インプリンティング面を用いてディスクにインプリンティングするステップと

を含み、第1の空気軸受けマンドレルが、ディスクの第1の中心線を案内して、インプリーンティング面の第2の中心線と同時位置合わせする方法。

【請求項20】

受動的に位置合わせするステップが、

上金型と下金型を有して、下金型に配置されて上金型と対向するインプリンティング面 を備える金型セットを用意するステップと、

ディスクを、インプリンティング面の上方、かつ下金型の空隙に隣接して配置するステップと、

ディスクの内径を、金型セットの上金型に結合された空気軸受けマンドレルのテーパ付 ノーズ部分に係合させるステップと、

上金型で、下金型を閉じるステップとをさらに含む請求項19に記載の方法。

【請求項21】

インプリンティング面に結合された複数のピコアクチュエータを用いて、インプリンテ 30ィング面の水平位置を調整するステップをさらに含む請求項20に記載の方法。

【請求項22】

インプリンティングするステップが、インプリンティング面に加熱要素を充填し、インプリンティング面をディスク上に押し付けるステップを含む請求項19に記載の方法。

【請求項23】

加熱要素が、高温流体を含む請求項22に記載の方法。

【請求項24】

インプリンティングするステップが、ディスクを流体で冷却するステップを含む請求項 19に記載の方法。

【請求項25】

流体が気体である請求項24に記載の方法。

【請求項26】

流体が液体である請求項24に記載の方法。

【請求項27】

受動的に位置合わせするステップが、

上金型と下金型を有し、下金型に配置されて上金型と対向するインプリンティング面を 備える金型セットを提供するステップと、

ディスクをインプリンティング面の上方、かつ下金型の空隙内に配置するステップと、 ディスクの内径を、金型セットの下金型に結合された第1の空気軸受けマンドレルのテ ーパ付ノーズ部分に係合させるステップと、

10

20

金型セットの上金型に結合された、第2の空気軸受けマンドレルの第2のテーパ付ノーズ部分を噛合わせて、上金型を載せて下金型を閉じるステップと

をさらに含み、金型が閉止されるときに、第1および第2のテーパ付ノーズ部分が、ディスク内径を案内して、第1および第2の空気軸受けマンドレルの中心線およびインプリンティング面と、同時位置合わせする請求項19に記載の方法。

【請求項28】

金型セットを提供するステップが、下金型がディスクの中心の周りを回転できるように、平坦面および球面の2重空気軸受けネストを金型セットの下金型に備えるステップをさらに含む請求項27に記載の方法。

【請求項29】

インプリンティング面の水平位置を、インプリンティング面に結合された複数のピコア クチュエータによって、調整するステップをさらに含む請求項27に記載の方法。

【請求項30】

インプリンティングするステップが、インプリンティング面に加熱要素を充填して、インプリンティング面をディスク上に押し付けるステップを含む請求項27に記載の方法。

【請求項31】

加熱要素が気体である請求項30に記載の方法。

【請求項32】

加熱要素が液体である請求項30に記載の方法。

【請求項33】

流体でディスクを冷却するステップをさらに含む請求項27に記載の方法。

【請求項34】

流体が気体である請求項33に記載の方法。

【請求項35】

流体が液体である請求項33に記載の方法。

【請求項36】

インプリンティング面をディスクと受動的に位置合わせする手段と、

インプリンティング面でディスクをインプリンティングする手段と

を含み、第1の空気軸受けマンドレルが、ディスクの第1の中心線を自由に案内して、インプリンティング面の第2の中心線と位置合わせする装置。

【請求項37】

受動的に位置合わせする手段がさらに、

上金型と下金型を有し、下金型に配置されて上金型と対向するインプリンティング面を 備える金型セットと、

ディスクを、インプリンティング面の上方、かつ下金型の空隙内に配置する手段と、 ディスクの内径を、金型セットの上金型に結合された空気軸受けマンドレルのテーパ付 ノーズ部分に係合させる手段と、

上金型を下金型の上において閉止する手段とを備える請求項36に記載の装置。

【請求項38】

インプリンティング面に結合された複数のピコアクチュエータを用いて、インプリンテ 40ィング面の水平位置を調整する手段をさらに備える請求項37に記載の装置。

【請求項39】

インプリンティング面に加熱要素を充填して、インプリンティング面をディスク上に押し付ける手段をさらに備える請求項37に記載の装置。

【請求項40】

インプリンティング面に気体を充填するための手段をさらに備える請求項39に記載の 装置。

【請求項41】

インプリンティング面に液体を充填するための手段をさらに備える請求項39に記載の 装置。

10

20

30

【請求項42】

インプリンティング面に冷却要素を充填して、インプリンティング面のディスクからの 分離を容易にする手段をさらに備える請求項37に記載の装置。

【請求項43】

ディスクを流体で冷却する手段をさらに備える請求項37に記載の装置。

【請求項44】

ディスクを気体で冷却する手段をさらに備える請求項37に記載の装置。

【請求項45】

ディスクを液体で冷却する手段をさらに備える請求項37に記載の装置。

【請求項46】

受動的に位置合わせする手段が、

上金型と下金型を有し、インプリンティング面が下金型に配置されて上金型と対向して いる金型セットと、

ディスクを、インプリンティング面の上方、かつ下金型の空隙内に配置する手段と、 ディスクの内径を、金型セットの下金型に結合された第1の空気軸受けマンドレルの第 1のテーパ付ノーズ部分に係合させる手段と、

金型セットの上金型に結合された、第2の空気軸受けマンドレルの第2のテーパ付ノーズ部分を噛合わせて、上金型を下金型の上において閉止する手段とをさらに備え、金型が閉止されるときに、第1および第2のテーパ付ノーズ部分が、ディスク内径を案内して、第1および第2の空気軸受けマンドレルの中心線およびインプリンティング面と位置合わ 20 せする請求項36に記載の装置。

【請求項47】

インプリンティング面に結合された複数のピコアクチュエータによって、インプリンティング面の水平位置を調整する手段をさらに備える請求項46に記載の装置。

【請求項48】

インプリンティング面に加熱要素を充填して、インプリンティング面をディスク上に押し付ける手段をさらに備える請求項46に記載の装置。

【請求項49】

インプリンティング面に気体を充填して、インプリンティング面をディスク上に押し付ける手段をさらに備える請求項48に記載の装置。

【請求項50】

インプリンティング面に液体を充填して、インプリンティング面をディスク上に押し付ける手段をさらに備える請求項48に記載の装置。

【請求項51】

インプリンティング面に冷却要素を充填して、インプリンティング面のディスクからの分離を容易にする手段をさらに備える請求項46に記載の装置。

【請求項52】

ディスクを流体で冷却する手段をさらに備える請求項48に記載の装置。

【請求項53】

ディスクを気体で冷却する手段をさらに備える請求項52に記載の装置。

【請求項54】

ディスクを液体で冷却する手段をさらに備える請求項52に記載の装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、ディスク・ドライブの分野に関し、より具体的には、ディスク・ドライブ・システムに使用されるディスクの位置合わせおよびインプリンティング (捺印法) に関する。

【背景技術】

[0002]

10

ディスク・ドライブ・システムは一般に、1つまたは複数の磁気記録ディスクと、ディスク上の略円形のトラック内部にデータを記憶する制御機構とからなっている。ディスクは、基板と、基板上に堆積された1つまたは複数の層とで構成される。ほとんどのシステムにおいては、アルミニウム基板が使用されている。しかしながら、ガラスなどの代替基板材料には、ガラス基板を使用するのが望ましい様々な性能上の便益がある。

アルミニウム、アルミニウム・マグネシウムなどの金属ベース材料のブランク・シートからディスク基板を製造するには、そのシートを打抜き加工して、内径(ID: inner diameter)と外径(OD: outer diameter)を有するディスクを生成することができる。内径と外径を打抜き加工した後に、ディスク形基板を熱処理して応力を除去し、次いで研磨 10 する。次いで、このディスクは、ポリマー・オーバーコートで被覆される。

[0004]

[0003]

磁気ハードディスクの設計における動向は、ディスク・ドライブ・システムの記録密度を増大させることである。記録密度は、ある面積のディスクに記憶できるデータ量の尺度である。記録密度を増大させるための一方法として、ディスクの表面をパターン化して、ディスクリート・トラック・レコーディング(DTR)と呼ばれる、ディスクリート・トラックを生成する方法がある。DTRディスクは、一般に、同心に配置された一連の、データ記憶のための凸ゾーン(ランド、エレベーションなどとも呼ばれる)と、サーボ情報を記憶させる凹ゾーン(トラフ、谷、溝などとも呼ばれる)とを有する。凹ゾーンは、凸ゾーンどうしを分離して、凸ゾーンへの意図しないデータ記憶を禁止すなわち防止している。

[0005]

DTR磁気記録ディスクを製造する1つの方法は、プリエンボス加工された剛体成形工具(スタンパ、エンボッサなどとも呼ばれる)による方法である。表面パターンの逆型がそのスタンパに生成され、この逆型が、ディスク基板の表面上に直接インプリンティングされる。次いで、薄膜磁気記録層が、基板のパターン化された面上にスパッタリングされて、これによって凸ゾーン、凹ゾーン双方の上に広がる連続的な磁気層を有するDTRメディアが生成される。データ記憶ディスク基板上にトラックをインプリンティングするために、インプリンティング・テンプレートを、静水圧をかけることによって曲率を変更できる可撓性支持に取り付ける。この圧力を適宜変えることによって、インプリンティング30面をディスク基板に接触させることができる。

[0006]

インブリンティング面がディスク基板と同心に位置合わせされていなければ、インブリンティングされたディスクが不良となる可能性がある。ディスク基板の中心線から過剰に位置ずれしてインブリンティングされたトラックは、ディスク・ドライブ・ヘッドで読み出したときに、正常に動作しない。この要件は、両面にトラックをインプリンティングすることが必要なハードディスク・ドライブで使用されるディスクにおいて特に重要である。そのために、ディスクのインプリンティングには位置合わせステップが必要であり、このステップでは、ディスク基板が実際にインプリンティングされる前に、ディスクの中心線がインプリンティング面の中心線と位置合わせされる。

[0007]

現在の位置合わせ方法では、一般に、高精度のアクチュエータまたはロボットを使用することが必要である。例えば、この高精度アクチュエータは、最初にディスク基板の中心線を求め、それをインプリンティング面の中心線と位置合わせさせる。このような高精度アクチュエータやロボットを使用することは、高価であり、維持費が高く、精度と信頼性が相反し、かつサイクル時間が長い。また、高精度アクチュエータやロボットは機械設備の重要な部分であり、広いフロア空間を必要とする。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

本発明は、高精度のアクチュエータや位置合わせ工具がなくても、高精度にディスクを 位置合わせでき、インプリンティングを行うことができるようにすることを課題とする。 【課題を解決するための手段】

[0009]

ディスクをインプリンティング面に位置合わせする装置および方法について記述する。 一実施熊様においては、この装置は、ディスクの内径に係合するテーパ付ノーズを有する 空気軸受けマンドレルを含む上金型と、空気軸受けマンドレルと同心の中心線を有する円 形のインプリンティング面と、ディスクを拘束する空気軸受け空隙を有する下金型とを有 する。上金型の下金型方向への軸方向の移動によって、ディスクの内径が案内されて、上 金型の中心線と同時位置合わせされる。

[0010]

添付した図面の図において、本発明を、限定としてではなく例として説明する。 【発明を実施するための最良の形態】

[0011]

以下の記述においては、本発明の様々な実施形態が完全に理解されるように、特性、構 成要素、工程の例などの具体的詳細を多数記載する。しかしながら、当業者には、これら の具体的詳細は、本発明の様々な実施形態を実施するために使用しなくてもよいことは明 らかであろう。他の例においては、周知の構成要素または方法については、本発明の様々 な実监形態を不必要にわかり難くすることを避けるために、詳細には記載していない。

[0012]

本明細書において論述する装置および方法は、様々な種類のディスクに使用できること を理解すべきである。例えば、一実施形態においては、本明細書で論述する装置および方 法は、磁気記録ディスクに使用することができる。あるいは、本明細書に論述する装置お よび方法は、その他の種類のディジタル記録ディスク、例えば、コンパクト・ディスク(CD)、ディジタル・ビデオ・ディスク(DVD)、および光磁気ディスクなどに使用す ることができる。

[0013]

一実施形態においては、本明細書で論述する装置および方法は、アルミニウム基板を用 いて実施することができる。アルミニウム基板に関係する装置および方法の記述は、説明 のためだけのものであり、アルミニウムまたは金属基板の位置合わせおよびインプリンテ 30 ィングだけに限定されることを意味するものではない。別の実施形態においては、ガラス 基板を含むその他の基板材料、例えば、ホウケイ酸ガラスおよびアルミノケイ酸ガラスな どのケイ酸含有ガラスを使用することができる。また、ポリマーおよびセラミックスを含 むその他の基板材料も使用することができる。

[0 0 1 4]

パターン化されたメディア製造のためのディスクを位置合わせする装置を使用するため の装置および方法を本明細書に記述する。一実施形態においては、ディスクは、インプリ ンティング面と受動的に位置合わせさせられ、それによって高精度のアクチュエータや位 置合わせ工具が不要となる。別の実施形態においては、この装置は、パターン化されたメ ディアの固有の横方向 (side-to-side) 位置合わせと反復性を確立する超高精度の金型セ 40 ットを含む。空気軸受け支持の位置合わせマンドレルが、ディスク基板の厚みのばらつき を吸収する円形エラストマーに結合されたインプリンティング面と共に上金型内に配置さ れている。空気軸受けマンドレルの中心線は、インプリンティング面の中心線と一致して いる。下金型は、実質的に、位置合わせの前にディスクを拘束する空隙の内径近くに位置 する環状空気「マニホルド」を含む。すべての金型本体構成要素、およびマンドレルを円 形構成で、かつ同一材料とし、それによって熱歪みを最小化すると共に空気軸受け面にお ける限界間隙を維持している。この位置合わせ工程は、空気軸受けマンドレルが、ディス クの中心線を自由に案内してインプリンティング面の中心線と位置合わせさせるという理 由で、受動的である。

[0015]

別の実施形態においては、高精度金型セットによって、パターン化されたメディアの基 本的な位置合わせと反復性が確立される。精密な、全システム位置合わせを達成するため に、空気軸受けが複数の位置で使用される。具体的には、空気軸受け支持位置合わせマン ドレルが、上部および下金型に配置される。空気軸受け位置合わせマンドレルは、噛合せ テーパ付ノーズ部分を有する。下金型は、1つの平坦面と1つの球面を備える2重空気軸 受けネスト内にある。また、基板の厚みのばらつきを吸収する円形エラストマー・パッド を、基板に隣接する空気軸受けマンドレルの中心に配置することもできる。金型本体要素 のほとんど、およびマンドレルは、円形構成、かつ同一材料として、これによって熱歪み が最小化され、空気軸受け面における限界間隙が維持される。

[0016]

別の実施形態においては、空気軸受け支持位置合わせマンドレルは、下金型内に置かれ る。密封封止された金型箔は、上部および下部の金型部片上の浅い空隙の上に溶接されて いる。金型本体要素のほとんど、およびマンドレルは円形構成、かつ同一材料であり、こ れによって熱歪みが最小化され、空気軸受け面における限界間隙が維持される。

[0017]

別の代替実施形態においては、パターン化された箔が、ピコアクチュエータ (pico-act uator) を介して位置合わせされて、定位置に保持される。空気軸受け支持位置合わせマ ンドレルが、下金型内にあって、ディスクを受け入れる。金型本体要素のほとんどとマン ドレルは、円形構成、かつ同一材料であり、これによって熱歪みが最小化され、空気軸受 け面の限界間隙が維持される。

[0018]

図1を参照すると、パターン化されたメディア製造のためのディスク位置合わせ装置1 00の一実施形態の断面図が示されている。一実施形態においては、装置100は、ディ スク180またはそれに類似の基板を受動的に位置合わせし、インプリンティングする。 ディスク180は、データ記憶用の磁気ディスク (例えば、ハードディスク・ドライブ用) でも光学式ディスクでもよい。装置100は上金型130と下金型135を備える。支 持部105、110とカラム115、120が上下の金型130、135を安定させる。 [0019]

上金型130は、上金型130の中央部分近く配置された空気軸受けマンドレル140 を含み、マンドレルは下金型135に向く方向にテーバが付けられたノーズを有する。空 30 気軸受けマンドレルは、空気軸受けマンドレルの受動的に軸方向に移動させることができ る空気マニホルド172によって支持されている。空気軸受けマンドレル110の直径は ディスク180の内径182に係合するように寸法決めされている。上金型130は空 気軸受けマンドレル140の周りに配置された第1のインプリンティング面160を備え る。一実施形態においては、第1のインプリンティング面160は、ディスク180の厚 みのばらつきを吸収するために、第1のエラストマー・パッド161に隣接させるか、あ るいは結合させることができる。第1のインプリンティング面160は、ディスクに押し 付けるためのトラック形状を有する箔とすることもできる。一実施形態においては、第1 のインプリンティング面160の形状はディスク180と一致する円形である。空気軸受 けマンドレル140の中心線は、第1のインプリンティング面160の中心線192と位 40 置合わせされている。

[0020]

下金型135は、エラストマー製環状体を収容するための円形の空隙165を有する。 また、下金型135は、実質的に空隙165内に配置され、ディスク180を位置決めす る環状空気マニホルド170を含む。一実施形態においては、ディスク180は浮遊させ らえることによって空隙165内に位置決めされる。さらに、下金型135は、空気軸受 けマンドレル140のテーパ付ノーズ145の先端部を受け入れるように寸法決めされた 円形開口150を有する。下金型135は、第2のエラストマー・パッド163に隣接し 、空気軸受けマンドレル140の第1のインプリンティング面160の中心線192と位 置合わせされた中心線194を有する第2のインプリンティング面162を有する。一実 50

施形態においては、空気軸受けマンドレル140を含む金型本体要素は、円形構成で、か つ同一材料にすることによって、熱歪みを最小化し、かつ空気軸受け面の限界間隙を維持 している。金型本体要素に使用可能な材料の例としては、それに限定はされないが、D2 、M2および440-Cなどの工具鋼がある。

[0021]

装置100を用いてディスク180を位置合わせして、インプリンティングする方法の 一実施形態においては、ディスク180は、任意の自動化方法によって、最初に(エラス トマーと加熱要素を含めることができる)円形空隙165上に配置される。例えば一実施 形態においては、ロボットまたはピック・アンド・プレース装置(「P&P」)が、ディ スク180を円形の空隙165内に設置する。内径182近傍に配置された環状空気スロ 10 ット170が、ディスク180を浮遊させることによって、ディスク180を下金型空隙 165の上方、千分の数インチに位置決めする。代替実施形態においては、第2のエラス トマー・パッド163に隣接する第2のインプリンティング面162をディスク空隙16 5の上に配置して、ディスク180の底面側と対向するように向ける。ディスク180は 、最初は、正常なディスク180の直径よりも1000分の数インチ大きい、浅い外径空 隙壁によって軸方向に拘束される。

[0022]

装置100は、下金型135に向かって軸方向に下降する上金型130によって閉じる 。金型組立体100が閉じると、空気軸受けマンドレル140のテーパ付ノーズ145が 浮上ディスク内径182を自由に案内して、上金型130の中心線190に同軸に位置合 ²⁰ わせする。空気軸受けマンドレル140は、空気軸受けで支持されてそれ自体の重量で下 向きの小さな力がかかって軸上を自由に移動するので、空気軸受けマンドレル140の中 心線190が、ディスク180の中心線196に位置合わせさせられ(あるいはその逆の)て、空気軸受けマンドレル140がディスク180に接触して制御し続ける。非常に少 量の清海な乾燥空気(clean dry air:「CDA」)が、ディスク180および空気軸受 けマンドレル140を支持するために必要となることがある。

[0023]

ディスク180の中心線196が空気軸受けマンドレル140と第1のインプリンティ ング面160との中心線192と合った状態で、上金型130が下金型135に向かって 降下し続ける。空気軸受けマンドレル140のテーパ付ノーズ145が、下金型135に 30 向かって下降し、第1のインプリンティング面160が、ディスク面と接触して、ディス ク180にインプリンティングする。インプリンティング面が、上金型130か、下金型 135か、または両者(例えば、第1および第2のインプリンティング面160、162)に配置されているかに応じて、ディスク180のどちらか片側、または両面にインプリ ンティングすることができる。この方法は、ディスク180のインプリンティング加工に 対して、精密な位置合わせと反復性とをもたらす。装置100は、ディスク180をイン プリンティング面に受動的に位置合わせし、それによって精密アクチュエータあるいはそ れに類似する機械を不要とする。したがって、装置100の使用によって、信頼性の向上 、作業コストおよび維持の低減、精度と反復性の向上、および迅速なサイクルタイムがも たらされる。一実施形態においては、装置100は、±5ミクロンまたは、さらに良いデ 40 ィスク対金型の位置合わせを達成する。

[0024]

図2は、パターン化されたメディア製造のためのディスク位置合わせ装置200の別の 実施形態の横断面図を示す。装置200は、基板(例えば、ディスク)を受動的に位置合 わせしてインプリンティングする。装置200は、上金型230および下金型235を有 する。上金型230は、その中央近くに配置された第1の空気軸受けマンドレル240を 含み、マンドレルは下金型235に対向するように向けられた第1のテーパ付ノーズ24 2を有する。第1の空気軸受けマンドレル240の直径は、ディスク280の内径282 に係合するように寸法を決められている。上金型230はまた、第1の空気軸受けマンド レル240の周りに配置された第1のインプリンティング面260を有する。一実施形態 50

20

においては、第1のインプリンティング面260は、ディスク580またはインプリンティング面260 (例えば、インプリンティング箔)の表面のばらつきを吸収するためのエラストマー・パッドを含むことができる。一実施形態においては、第1のインプリンティング面260はディスクと一致する円形をしている。第1の空気軸受けマンドレル240の中心線290は、第1のインプリンティング面260の中心線292と位置合わせされている。支持部205、210は、上金型230および下金型235を安定化させる。【0025】

下金型235は、第1の空気軸受けマンドレル240の第1のテーパ付ノーズ242に向けられた第2のテーパ付ノーズ244を備え、中央部分の近くに配置された第2の空気軸受けマンドレル245を有する。第1の空気軸受けマンドレル240の第1のテーパ付 10ノーズ242と同様に、第2の空気軸受けマンドレル245の第2のテーパ付ノーズ244も、ディスク280の内径282に保合するように寸法が決められている。一実施形態において、下金型235も、第2の空気軸受けマンドレル245の周りに配置された第2のインプリンティング面262を有する。第2の空気軸受けマンドレル245の中心線294は、第2のインプリンティング面262の中心線296と位置合わせされている。一実施形態においては、装置200の下金型235は、1つの平坦面246および1つの球面278を備える2重空気軸受けネスト内にある。平坦面246および1つの球軸受けネストによって、ディスク280上面の理論中心298の周りに回転する移動自由度を下金型235の球形シート250に与えている。

[0026]

装置200を用いてディスク280を位置合わせし、かつインプリンティングする方法の一実施形態においては、最初にディスク280を、下金型235の上に(例えば、ロボットまたはP&P装置によって)配置し、第2の空気軸受けマンドレル245の第2のテーパ付ノーズ244が、ディスク280の内径282と係合させる。具体的には、ディスク280を下部マンドレル245に配置し、下金型235の空隙265内で、第2のインプリンティング面262の1000分の数インチ上方にディスクを固定している。空隙265は、下金型235内に、ディスク280を収容するためにディスク280よりもわずかに大きな寸法にされている。

$[0\ 0\ 2\ 7]$

ディスク280は最初に、第1のテーバ付ノーズによって、次いで下金型235の第2 の空気軸受けマンドレル245の第2のテーパ付ノーズ244によって、軸方向に位置決 めされる。上述のように、精密空気軸受け線形マンドレル(例えば、第1の空気軸受けマ ンドレル240)が上金型230内にある。上金型と下金型230、235が閉じると、 第1および第2の空気軸受けマンドレル240、245のノーズ242、244がテーパ 面を備える3本指形状を有し、それによってそれらが噉合い、ディスク280を両方の内 径面取り部で捕捉できる。このようにして、芯出しされたディスク280を接続媒体とし て使用して、下金型235が上金型230に対して位置合わせされる。上金型230の第 1の空気軸受けマンドレル240は、それ自体の重量(および必要であれば、空気圧)に よって、下方に付勢され、下金型235の第2の空気軸受けマンドレル245は、小さな 空気圧差で上方に付勢される。下金型235は、平坦空気軸受け面276上に自由に浮上 40 して、上金型230の中心線290と位置合わせさせられる。第1のインプリンティング 面260および第2のインプリンティング面262の面合わせは、球形シート250の球 形空気軸受け面278の受動的移動によって達成される。面278は、ディスク280の 上面の中央点を焦点とする曲率半径を有し、これによってディスク280と第2のインプ リンティング面262との間の相対移動が最小化される。一実施形態においては、球形シ ート250の過剰な移動自由度を、クリート(すべり止め)によって制御することができ る。ごく少量のCDAを使用して、空気軸受けマンドレル240、245を支持してもよ い。そうすると、装置200は、完全浮上、多軸の下金型および空気軸受けマンドレルを 使用することによって、インプリンティング面に対するディスクの両面の自動位置合わせ を達成する。金型セット205、210が非常に精密である場合には、球形位置合わせ機 50 構を撤去し、平坦面システムを保留して、205、210の同軸位置合わせを達成するこ とができる。

[0028]

図3は、パターン化されたメディア製造のためのディスク位置合わせ装置の別の実施形 態の断面図である。装置300は、パターン化されたメディア(例えば、ディスク)の基 礎的な位置合わせと反復性を確立する上金型330と下金型335とを有する。下金型3 35は、 F金型 330 に向かって延びるテーパ付ノーズ 342を備え、中央部近くに配置 された、空気軸受け支持位置合わせマンドレル340を有する。支持部305、310お よびカラム315、320は、上金型330および下金型335を安定させる。

[0029]

空気軸受けマンドレル340のテーパ付ノーズ342は、ディスク380の内径382 に係合するように寸法決めされている。図7A、7Bに関して以下により詳細を記述する ように、インプリンティング面360、362は、上部部分および下部部分330、33 5の上を密閉封止して、浅い空隙350、351、352、353を形成することができ る。上金型と下金型330、335はまた、密閉封止された浅い空隙350、351、3 52、353と流体連通した、インプリンティング面360、362をディスク380に 押し付けるのに使用される流体(例えば、液体または気体)を分配するための、加圧流体 排出口370、372、374、376を有する。一実施形態においては、装置300は 全部で4つの加圧流体排出口を有するが、4つを上回るか、または下回る排出口を使用す ることもできる。下金型335の空気軸受けマンドレル340の中心線390が、上金型 20 と下金型330、335上に配置されたインブリンティング面360、362と位置合わ せされている。下金型335はマンドレル340の軸方向移動を可能にするスプリング3 45を有する。すべての金型部品は、円形構成で、同一材料であり、これによって熱歪み を最小化すると共に、空気軸受け面での限界間隙を維持している。

[0030]

一実施形態においては、ディスク基板(例えば、ディスク380)と接触するときの追 従性をもたらすために、インプリンティング面360、362は柔軟な材料で製作される 。ディスク基板は厚さに固有のばらつきがあることがあり、このために、ばらつきを吸収 するためにインプリンティング面360、362を柔軟にする必要がある。図7Aは、金 型720、722の上を密閉封止して密閉封止した空隙730、732を形成したインプ 30 リンティング面710、712の一実施形態の横断面図を示す。説明をわかり易くするた めに、ディスク位置合わせ装置全体は示していない。インプリンティング面710、71 2は、溶接 (例えば、レーザまたはロウ付け)、はんだ付け、または電気アーク溶接によ って、金型720、722に封止することができる。インプリンティング面710、71 2を金型720、722に溶接することによって、インプリンティング工程中に、空隙7 30、732を通過する流体の漏れを防止することができる。図7日は、金型720、7 22の上を密閉封止するインプリンティング面710、712の別の実施形態の断面図を 示す。この実施形態においては、Oリング740、742を使用して、金型720、72 2上のインプリンティング面710、712を封止している。金型空隙730、732を わずかに真空にすることによって、金型固定の締め付け操作が確立されるまで、インプリ 40 ンティング面710、712を定位置に保持することができる。代替案として、エラスト マー材料(例えば、ゴムおよびその他同等のポリマー)および金属(例えば、超高真空シ ールに使用される)を〇リングの代わりに使用することができる。

[0031]

当業者であれば、インプリンティング面に隣接して前もって成形される空隙は、局所的 な加熱要素および冷却要素の適用には、必要でないこともあることを理解するであろう。 一実施形態においては、機械式ピストンを、インプリンティング面に隣接して配置し、こ れによってディスク基板と強制的に接触させることができる。代替手法として、インプリ ンティング面に加熱要素または冷却要素を適用することによって、空隙を、ディスク基板 と接触するインプリンティング面のフレックス(flex)として形成させることができる。

[0032]

再び図3を参照すると、装置300を用いてディスク380を位置合わせしてインプリ ンティングする方法の一実施形態において、ディスク380は、下金型335の空気軸受 けマンドレル340上に(例えば、ロボットまたはP&P装置によって)配置される。配 置する際に、ディスク380を、下金型空隙352のインプリンティング面362の上方 1000分の数インチに位置させる。上金型330を下金型335の上に閉じると、ディ スク380は、ディスク380の内径382が、空気軸受けマンドレル340のテーパ付 ノーズ部分342と係合した状態で、位置固定される。上金型330と下金型335が閉 じると、ディスク380の中心線396は、上金型と下金型の中心線390、392に位 置合わせされる。次いで、インプリンティング面360、362の下にある空隙350、 352に、高圧流体 (例えば、気体または液体) が充填されて、インプリンティング面の 形状をディスクのポリマー被膜に押し付ける。流体は、加圧流体排出口370、372、 374、376を介して供給される。使用することのできる流体としては、それに限定は されないが、高圧ガス (窒素)、油圧油、およびDow Therm (商標) またはMa rlotherm N(商標)などの熱作動流体がある。インプリンティング工程を完了 するには、圧力をゼロまで下げて、空隙中に流休を流し、続いて流休によって残存熱を運 び出し、ディスク380のインプリンティングされた面を冷却する。ディスクとインプリ ンティング面を冷却することによって、インプリンティング面からディスクを分離し易く することができる。

[0033]

ディスク基板の被膜は、パターン化基板の一体部分としてもよく、または適当に形成し た後に除去してもよい。スタンパを介して、その形状を被膜にインプリンティングするこ とによって、その後に基板に材料を加えたりまたは基板の一部を削除(例えば、マスクを 介してのメッキ、またはマスクを介してのエッチング)したりして、基板表面にパターン を形成するステンシルとして使用することができる。その際、インプリンティングを高い 基板温度で実施すると、それが容易になることが多い。後者の場合には、結果として得ら れるマスクは、基板への添加または除去ステップを実行した後に除去されることになる。 高温にすることによって、インプリンティングしようとする材料を軟化させ、それによっ てエンボス形状忠実性を向上させ、スタンパ寿命を増大させることができる。スタンパの インプリンティング面からの分離は、基板をインプリンティング温度よりも低く冷却する 30 ことによって容易になる。したがって、プレス機には、スタンパによってインプリンティ ングする以前または以後に、ディスク基板を、加熱または冷却する要素を設置するのが望 ましいことがある。そのような冷却要素や加熱要素は、好ましくは、それらの要素を各ス タンパの背面に近接して配置することによって行われる。ディスク基板の局所的な加熱お よび冷却は、有効なインプリンティングを達成するためには必要でないこともある。ディ スク位置合わせ装置(例えば、装置300)全体を、加熱および冷却要素にかけて、ディ スク基板をインプリンティングしてもよい。

[0034]

上記で説明したように、加熱および冷却の一方法として、インプリンティング面(例え ば、インプリンティング面360、362)、膜、または箔の背後の空隙内に高温または 40 低温流体を使用する方法がある。代替案として、環状ブロックを、インプリンティング面 の近接して配置することもできる。これらのブロックに、埋め込み式電気加熱コイルまた は熱電式冷却装置を含めることができる。別の実施形態においては、環状水晶加熱ランプ または、インプリンティング面近くに配置されて接着された抵抗リボンを冷却流体と組み 合わせて使用することができる。

[0035]

図8は、ディスクのインプリンティング用の加熱・冷却装置の一実施形態を示す。この 装置は、ディスク位置合わせシステムの流体排出口(例えば、図3の370、372、3 74、376)と流体連通して、ディスク基板にインプリンティングをするための加熱お よび冷却要素を供給するための加圧流体供給源を有する熱力学的プレス800を含む。説 50

明をわかり易くするために、インプリンティング面820をディスク基板810に隣接し て配置して、ディスク基板810の部分断面図を示してある。密閉封止された空隙830 は、インプリンティング面820に隣接して配置されている。空隙830は、加熱要素8 40に流体連通するポート860と熱交換器870と流体連通するポート862とを有す る。

[0036]

動作においては、加熱コイル842が、加熱要素840に収容された流体844(例え ば、液体または気体)を作動温度まで加熱する。加熱要素840のピストン805は、高 温の作動流体844を、加熱要素840からポート860を介して空隙830中に送り込 む。作動流体は空隙830から出て、不活性ガス(例えば、窒素)をポート862を介し 10 て熱交換器870に排出させる。次いで、チェック・バルブ880、882を起動して作 動流体844の自由流を停止させ、ピストン805が予め選択した力になり、作動流体8 44の熱を伝達することによって、インプリンティング面820をディスク基板810に 押し付ける。次いで、ピストン805を引き戻し、システム圧力を低減させると共に、高 温の作動流体844を流体帰還ライン890を介して引き出す。熱交換器870からの冷 却ガスがそれに従って空隙830に存在する高温流体に置き換わり、インプリンティング 面820を冷却する。

[0037]

図4は、パターン化されたメディア製造のためのディスク位置合わせ装置400の別の 実施形態の斜視図を示す。装置400は、基板(例えば、ディスク)を位置合わせてして 20 インプリンティングする。装置400は、パターン化されたメディア(例えば、ディスク)の基本的な反復性を確立する上金型430および下金型435を有する。支持部405 、410とカラム412、414、416(4番目のカラムはこの図では示されていない)が上金型430および下金型435を安定化させる。下金型435は、中央部分の近く に配置されて、上金型430に向かって延びるテーパ付ノーズ445を備える、空気軸受 け支持位置合わせマンドレル(図示せず)を有する。空気軸受けマンドレルのテーパ付ノ ーズ445は、ディスク480の内径482に係合するように寸法決めされている。上金 型と下金型430、435は、同様に第1および第2のインプリンティング面を有する。 この図では、第2のインプリンティング面462のみが示されている。

[0038]

一実施形態においては、第1および第2のインプリンティング面460、462は、ピ コアクチュエータイ70、172によって定位置に保持されており、このアクチュエータ が第1および第2のインプリンティング面460、462の横移動を制御する。上金型お よび下金型430、435は、同様に環状ピストン(図示せず)を充填してインブリンテ ィング面をディスク480に押し付けるのに使用される流体の供給と排出用の加圧流体排 出口450、452を有する。下金型435の空気軸受けマンドレル440の中心線49 のは、上下の金型430、435に配置されたインプリンティング面460、462と位 置合わせされている。金型本体要素のすべてと、空気軸受けマンドレル440は、円形構 成、かつ同一材料であり、これによって熱歪みを最小化すると共に、空気軸受け面での限 界間隙を維持している。

[0039]

装置400を用いてディスク480を位置合わせしてインプリンティングする方法の一 実施形態においては、ディスク480は、マンドレル440のテーパ付ノーズ部分445 の上に(例えば、ロボットまたはP&P装置によって)設置されて、下金型435の第2 のインプリンティング面462の上方、1000分の数インチにある。上金型430は、 ディスク480上に閉じて、インプリンティング面460、462に対して位置固定され る。上金型と下金型430、435が閉じると、ディスク480の中心線が、上金型と下 金型430、435の中心線(装置400のこの斜視図においては中心線は示されていな い)と位置合わせされる。次いで、インプリンティング面460、462の下にある空隙 (図示せず) に高圧ガスが充填されて、インプリンティング形状がポリマー被膜に押し付 50

けられる。流体は、加圧流体排出口450、452を介して供給される。インプリンティ ング工程を完了するには、圧力をゼロに低減し、排出ガスが空隙中を流れ、残留熱を除去 すると共に、インプリンティングされたディスク480の表面を冷却する。代替手法にお いては、水素または酸素などの可燃性ガスを使用して、熱および衝撃圧力を生成させて、 インプリンティング面をディスク480のポリマー層にエンボス加工することができる。 続いて空隙を掃気することによって、箔およびポリマーが冷却される。

[0040]

図5は、フローチャートの形態で、パターン化されるメディア製造用の受動的ディスク 位置合わせの一方法を示している。この方法では、ブロック510で、上金型とそn上金 型に対向する下金型とを有する金型セットを用意することから開始され。下金型にはイン 10 プリンティング面または箔を備えている。次いで、ブロック520では、下金型の空隙内 で、ディスクをインプリンティング面の上方に浮上させる。ブロック530で、ディスク の内径が、金型セットの上金型に結合された空気軸受けマンドレルのテーパ付ノーズ部分 に係合する。ブロック540で、上金型が下金型の上に閉じられて、空気軸受けマンドレ ルのテーパ付ノーズ部分が、浮上ディスク内径を案内して、空気軸受けマンドレルとイン プリンティング面の中心線を同時に位置合わせする。

[0 0 4 1]

図6は、フローチャートの形態で、パターン化されたメディア製造用受動的ディスク位 置合わせの別の方法を示している。この方法では、ブロック610で、上金型と下金型を 有し、インプリンティング箔が下金型に配置されて、上金型と対向している金型セットを 20 用意することから開始される。次いで、ブロック620で、下金型の空隙内で、ディスク をインプリンティング箔の上方に位置させる。プロック630で、ディスクの内径が、金 型セットの上金型に結合された第1の空気軸受けマンドレルの第1のテーパ付ノーズ部分 に係合する。ブロック640で、金型セットの下金型に結合された、第2の空気軸受けマ ンドレルの第2のテーパ付ノーズ部分が、第1のテーパ付ノーズ部分と嘲合う。上下の金 型が閉じると、第1および第2のテーパ付ノーズ部分は、ディスク内径を案内して、第1 、第2の空気軸受けマンドレルとインプリンティング箔の中心線とを同時に位置合わせす る。

[0042]

前述の明細書において、本発明を、その例示的な特定の実施形態に関して記述した。し 30 かしながら、添付の請求の範囲に記載する本発明のより広い意味での趣旨と範囲から逸脱 することなく、それらの実施形態に様々な修正と変更を加えることができることは明らか であろう。したがって本明細書および図面は、説明のためのものであり、限定を意図する ものではない。

【図面の簡単な説明】

[0043]

【図1】パターン化されたメディア製造用の半受動ディスク位置合わせ装置の一実施形態 を示す図である。

【図2】バターン化されたメディア製造用の受動ディスク位置合わせ装置の一実施形態を 示す図である。

【図3】パターン化されたメディア製造用の半受動ディスク位置合わせ装置の別の実施形 態を示す図である。

【図4】パターン化されたメディア製造用の半受動ディスク位置合わせ装置の別の実施形 態を示す図である。

【図5】バターン化されたメディア製造用のディスク位置合わせの一方法を示す、フロー チャートである。

【図6】バターン化されたメディア製造用のディスク位置合わせの別の方法を示す、フロ ーチャートである。

【図7】金型の上方を封止したインプリンティング面の一実施形態の断面図(A)と金型 の上方を封止したインプリンティング面の別の実施形態の断面図(B)である。

【図8】ディスク基板をインプリンティングするのに使用することのできる、熱力学的プレスの一実施形態を示す図である。

【符号の説明】

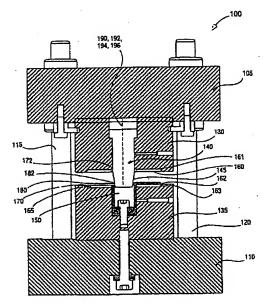
[0044]

- 100、200、300、400 ディスク位置合わせ装置
- 105、110、205、210、305、310、405、410 支持部
- 115、120、315、320 カラム
- 130、230、330、430 上金型
- 135、235、335、435 下金型
- 140、240、340、440 空気軸受けマンドレル
- 242、342 テーパ付ノーズ
- 160、260、360、460 第1のインブリンティング面
- 161 エラストマー・パッド
- 162、262、362、462 第2のインプリンティング面
- 165、265、730、732、830 空隙
- 172 空気マニホルド
- 370、372、374、376 加圧流体排出口
- 180、280、380、480 ディスク
- 450、452 加圧流体排出口
- 710、712、820 インプリンティング面

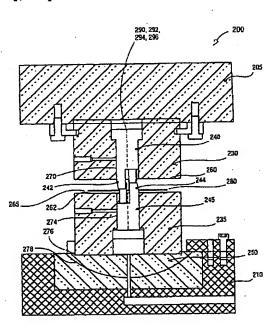
20

10

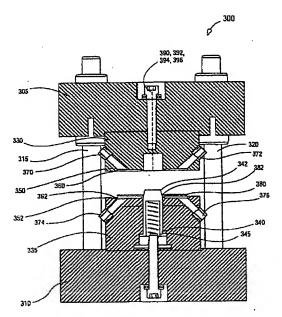
【図1】



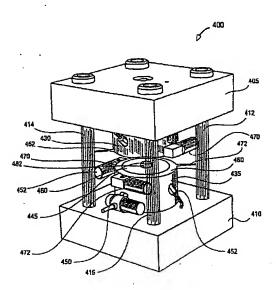
【図2】



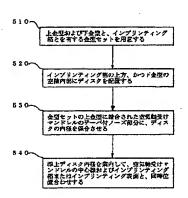
【図3】



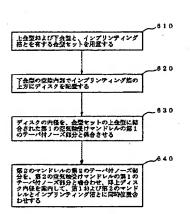
【図4】



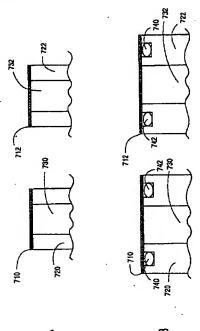
【図5】



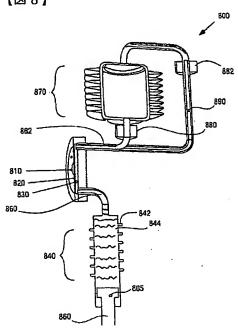
【図6】



【図7】







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.